

平成 29 年度 EIIRIS プロジェクト研究募集要項

1. 目的

本学における大学院生・若手研究者を擁する大学院の知的活力を活用し、研究科・専攻の枠を越えた様々な研究者等と協力して、起業家マインドを持ち、独創的・創造的な研究・開発を推進するとともに、高度の専門的職業能力を持つ創造的な人材育成を推進し、異分野融合研究、産学連携および社会貢献に繋がる研究開発を目的とする。

2. 研究開発テーマ

対象となる主な研究テーマは下記の通りです。

- 1) LSI 工場を活用した機能集積化知能デバイスの開発・研究
- 2) 次世代を見据えた先端的異分野融合研究・開発
- 3) EIIRIS の研究施設・設備を活用した研究・開発

3. 応募資格等

- 1) 応募対象となるプロジェクト研究は、上記研究開発テーマ、およびそれに関連するテーマなどを中心としたプロジェクト研究とするが、それ以外のテーマも考慮する。
- 2) 本学教員を中心とした研究・開発グループとし、研究代表者としての応募は原則として 1 件とする。例外がある場合は、EIIRIS スタッフ会議にて協議し、決定する。
- 3) 研究期間は 3 年間を原則とする。ただし、継続しているプロジェクト研究の代表者も計画書(応募書類)を提出し、選考会の審査を受けなければならない。

4. 募集期限

平成 29 年 5 月 19 日 (金)

5. 応募書類

EIIRIS プロジェクト研究計画書 (様式 1)

6. 応募書類の提出先

研究支援課センター支援係 内線 6574 / E-mail : kencen@office.tut.ac.jp

7. EIIRIS・VBL 資源の利用

プロジェクト研究に採択された者は、以下の EIIRIS・VBL 資源を利用することができる。

○物的資源 (施設・設備) :

- ・ VBL 機能集積化デバイスプロセス室および固体機能デバイス施設
共同利用研究室(1)~(3)、その他 VBL 内施設・設備
※VBL の物的資源利用方法詳細は、VBL ホームページを参照のこと
- ・ EIIRIS 共焦点レーザー顕微鏡をはじめとするバイオ関連実験設備
各種計測・分析装置
化合物半導体デバイスや MEMS デバイスなどの作製機器・設備
※EIIRIS 内の物的資源の利用に関しては、担当教員の了解のもと実施すること

8. 選考方法・結果通知

EIIRIS 所長および所長より指名された者が選考し、結果を 5 月下旬 (予定) に通知する。

9. 研究成果の公開等

プロジェクト研究代表者は、原則として年度毎に研究成果報告書を EIIRIS 所長に提出するとともに、研究成果報告会においてポスター発表や口演による成果報告を行う。また、各種講演会、セミナー等、EIIRIS の研究活動の推進・広報に積極的に協力するものとする。

異分野融合 EIIRIS プロジェクト研究の資源利用について

EIIRIS-VBL 施設・設備

- 1) 原則として施設・設備の使用料は徴収しません。
- 2) プロジェクト研究が終了した時点で、原状に復帰してください。
- 3) 施設・設備の使用は、各申請プロジェクトに所属する職員が講習を受け、ライセンスを得た後に行っていただきます。(大学院生は当該職員の指導の下で行ってください。) 使用規程の詳細は別途定めます。
- 4) 使用の目安

○VBL

- ・ 1階機能集積化デバイスプロセス室および固体機能デバイス施設には、シリコン集積回路およびMEMSを作製、評価するための設備が整っています。
- ・ 2階共同利用研究室には、分光エリプソ、低雑音プローブシステム、分光光度計、超電導マグネット、蛍光寿命装置があります。また、窒素ガス、循環冷却水が備えられています。

○EIIRIS

- ・ 共焦点レーザー顕微鏡をはじめとする各種光学顕微鏡、クリーンベンチなどバイオ関連実験機器やラマン分光装置・環境計測用SEMなどの分析装置を備えています。

*常勤の管理者が必要なものや実験操作に支援が必要な設備・装置がありますので、担当の教員と相談の上、運用してください。なお、研究所内の設備・装置に関しては直接研究所へ問い合わせください。見学等が必要な場合も対応いたします。